

ゼータ電位・粒子径測定装置 および膜厚計の紹介

日時: 9月16日(水)13:00~14:30

場所: 理系複合棟321室

講師: 大塚電子(株) 長谷川 泰三 氏

主な内容:

- ① 粒度分布・ゼータ電位測定
- ② 膜厚計

概要

- ①: 粒子径・ゼータ電位は、ナノテク技術(分散・凝集・表面改質)の評価に重要なパラメータです。今回は光散乱法による粒子径・ゼータ電位測定の原理と食品・バイオ・医薬品分野をメインに様々な応用例についてご紹介します。
- ②: 分光干渉方式による膜厚測定は非接触・非破壊かつ高速・高精度な膜厚測定が可能です。この度は薄膜から厚膜まで幅色い膜厚に対応しており、様々な膜種の屈折率(n)、消衰係数(k)、膜厚(d)、反射率の測定が可能な分光干渉方式膜厚計の原理と応用例についてご紹介します。

申込み

予約QRコードまたは
下記のサイトでご予約ください。

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=90

申込期限: 9/15 15:00まで (以降は当日会場にて受付)



問い合わせ先

機器分析支援センター事務室(理系複合棟307室)

技術専門職員 儀間 真一

TEL: 895-8967 HP: <http://www.irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>